

真空蒸着装置



真空蒸着装置
アネルバ（株）
VD-43N

平成5年度導入

【主な用途・仕様】

金属薄膜の成膜

- ・ 試料サイズ：φ 2 インチ程度
- ・ 蒸着方式：電子線加熱
- ・ 膜種：Au、Cr、Pt etc

【設備使用】

真空蒸着装置

【委託分析試験】

マイクロマシニング加工 (B)